Japanese Patent Laid-open Publication No. HEI 5-273082 A

Publication date: October 22, 1993

Applicant : Hyutoret Pakkado K. K.

Title : POLARIZING MODE DISPERSAL DETERMINING APPARATUS OF

5 OPTICAL APPARATUS AND METHOD THEREOF

[ABSTRACT]

10

15

20

[OBJECT] To generate different polarizing states of a light ray and determine polarizing mode dispersal in an optical apparatus by determining a polarizing state to be generated by means of operation on the light ray by the optical apparatus during an inspection.

[SOLUTION] A polarizing light source 9 generates light rays provided with three polarizing states sequentially for at least two wavelengths and the light rays provided with three polarizing states enter in an optical network for each wavelength. Further, a polarimeter 10 measures the polarizing state, which is generated by the operation of the foregoing optical network, for the foregoing three polarizing states and for each wavelength to calculate the polarizing mode dispersal from the polarizing state, which is measured by the foregoing polarimeter.

[0019]

10

15

20

25

[EXAMPLE]

Fig. 6 shows a whole view of an example of an apparatus to attain accurate and simple determination of the polarizing dispersal mode, which is configured according to the present invention, with denoted by a reference numeral 8. The apparatus 8 is provided with a light source 9, which is polarized, for transmitting the light ray 1 to an optical apparatus (DUT) 30 during inspection and a polarimeter 10 for receiving a part of the light ray I penetrated by DUT. In actual, the polarized light source 9 may be configured by a light source 40 and a polarized synthesizer 50, which is illustrated by dotted lines around the foregoing light elements in Fig. 6. For example, the light source 40 may be single or plural solid lasers for generating the light rays having different predetermined wavelengths such as 1300 nanometer and 1302 nanometer. These wavelengths are capable of being achieved by using, for example, a laser, which can be tuned, or it is capable of being achieved by a laser having a wide spectrum or other light sources and a monochrome measurer for selecting a wavelength. Conceptually, it is easier to understand determination of the polarized mode dispersal according to the present invention by explanation in use of two successive light rays. However, in order to illuminate the DUT 30 at the same time by the light ray having a wavelength with a wide spectrum, a light source with a wide spectrum may be used.

Alternatively, in order to select the wavelength to be measured by the polarimeter 10, the monochrome measurer may be used at any position.

[0020]

5

In order to insert three different polarizing elements 50a, 50b and 50c into a passage of the light ray to be generated by the light source 40 and generate three successive polarizing states of the light ray 1, it is preferable that the polarized synthesizer 50 is automated. Alternatively, the polarizing elements 50a, 50b and 50c are preferably configured so as to penetrate a linear polarizing state or they may be selected to penetrate an elliptical polarizing state. Another polarized light generator may be used, which includes a variable frequency wave table or a rotatable frequency wave table.

15

20

25

10

[0039]

In an apparatus and a circuit network, in which time delay is dominant for a phase change, approximate calculation of an equation (8) and an equation (9) is reasonable even when Δ ω is large. Further, as another back ground, an effective and compact formula for processing the polarizing property in an optical system was introduced by R. C. Jones during 1941 to 1956. Please refer to "new infinitesimal calculus for processing in optical system, (1) description and study of infinitesimal calculus", by Jones, R. C., (J. Optical Institute, AM., 31,

1941, p. 488 to 493), "new infinitesimal calculus for processing in optical system (2) demonstration of three basic equivalent propositions", by Jones, R. C., (J. Optical Institute, AM., 31, 1941, p. 493 to 499), "new infinitesimal calculus for processing in optical system (3) Sohncke theory for optical operation", by Jones, R. C., (J. Optical Institute, AM., 31, 1941, p. 500 to 503), (4) "new infinitesimal calculus for processing in optical system", by Jones, R. C., (J. Optical Institute, AM., 32, 1942, p. 486 to 493), "new infinitesimal calculus for processing in optical system (5) more basic formula and another distribution of infinitesimal calculus", by Jones, R. C., (J. Optical Institute, AM., 37, 1947, p. 107 to 110), "new infinitesimal calculus for processing in optical system (6) experimental determination of matrix", by Jones, R. C., (J. Optical Institute, AM., 37, 1947, p. 110 to 112), "new infinitesimal calculus for processing in optical system (7) property of N-matrix", by Jones, R. C., (J. Optical Institute, AM., 38, 1948, p. 671 to 685) and "new infinitesimal calculus for processing in optical system (8) electromagnetic theory", by Jones, R. C., (J. Optical Institute, AM., 46, 1956, p. 126 to 131). A general outline of the infinitesimal calculus by Jones is described in fourth chapter of "polarized light in optics and stereoscopy", by Cregar, D. S., Luis, J. W and Randarl, C. E., (Academic Publication, San Diego, issued in 1990).

25 [0040]

10

15

20

Generally, Jones introduced a clear mathematical expression to determine experimentally a forward permeability matrix M in the optical apparatus, which is unknown, linear and time fixed ("new infinitesimal calculus for processing in optical system (6) experimental determination of matrix", by Jones, R. C.), (J. Optical Institute, AM., 37, 1947, p. 110 to 112). Such a prescription excludes an optical apparatus for generating a new optical frequency, which is different from the optical frequency of an incident light. Further, Jones vector is not capable of being used for representing a field, of which the light is partly polarized. However, since a light ray from a light source can not be completely paralyzed by a linear polarizing element, the above matter is not a substantial restriction. Further, the matrix of Jones is not capable of representing the extinction of the polarized light of the DUT. However, it is possible to delete an extinction operation of the polarized light by using a light source of a semi monochrome having full long length of connection. [0041]

10

15

According to the infinitesimal calculus by Jones, it is possible to represent an input optical electric field by an electric field vector Hat \mathbf{v} (having - on a mark \mathbf{v} , and so forth) of combined step of 1×2 for specifying completely a phase and a state of a light ray such as a light ray L as shown in Fig.

25 6, although it has the above mentioned restrictions. Two

combined elements of this vector represent amplitude and a phase of a x component and a y component of the optical electric field, respectively. It is difficult to measure two optical phases since an optical interference measurer is needed. However, it is rather easy to measure a relative phase between a x line and a y line. The Jones vector only including relative phase information is called a Jones vector v, which is round down. The Hat v and v relate to each other with respect to an optical phase item. In other words, the following angle θ exists.

[0049]

Here, it is assumed that k=1, 2, wholly. In the case that the equation (9) is satisfied, zl and z2 are referred as to an input basis state of polarized light and wl and w2 are referred as to an output basis state of polarized light. The output basis state of the polarized light relates to two groups' delay, τg , 1 and τg , 2. It means that an absolute phase ϕk of the output basis state of the polarized light changes in accordance with a frequency, in other words, $d\phi k / d\omega = \tau g$, k. The input basic state and the output basic state of the polarized light are generally functions of the optical frequency. Also, a group delay difference of the polarizing mode, $\tau PMD = |\tau 1 - \tau g 2|$, is basically a function of the optical frequency. An example of a method according to the present invention for determining the polarizing mode in the optical DUT 30 is based on measuring

of the strength of a permeable part of the light ray $\Delta 1$, which is necessary for introducing the output optical electric field by two wavelength, respectively, calculating a Jones matrix for the optical DUT 30 from the input and output Jones vector and satisfying the Jones vector of the input optical electric field with respect to the three polarizing states, which are identified in each of the two wavelengths. Then, the method according to the present invention determines the polarized mode dispersal in the optical DUT 30 from the calculated Jones matrix. Therefore, it is possible to determine accurately the polarized mode dispersal in the optical DUT 30 and it is possible to decrease actual number of measuring to be performed, so that the determination of the polarized mode dispersal can be performed speedy and easily. Next, the method for determining the polarized mode dispersal according to the present invention will be explained in detail. An example of a method according to the present invention determines the permeable polarized mode dispersal of the optical DUT 30 shown in Fig. 6 in accordance with three successive well-known polarizing states of the light ray l in each of the two wavelengths. The output from the light source 40 is connected to the input of the polarized synthesizer 50. This polarized synthesizer is used to convert the polarizing state of the light ray to be generated by the light source 40 in each of the two wavelengths into three predetermined sequential polarizing states, for example, a horizontal, a 60

10

15

20

25

degrees and a 120 degrees liner polarized light. It is not necessary that the three states of the polarized light have the same strength.

[0050]

5

10

15

20

25

The output from the polarized synthesizer 50 is connected to the input of the optical DUT 30. The optical DUT 30 has an unknown permeable Jones matrix in each of the two wavelengths. As described later, it is possible to determine the polarized mode dispersal of the optical DUT 30 from this Jones matrix after determining the matrix. According to the method of the present invention, the unknown Jones matrix is calculated from measurement of response of the optical DUT 30 (measurement of a stroke parameter) with respect to the predetermined sequential polarizing states of the light ray lineach of the two wavelengths.

Considering in more detail, an example of the method for determining the polarized mode dispersal in the optical DUT 30 is illustrated in Fig. 8. As shown in Fig. 8, an example of the method for determining the polarized mode dispersal of the present invention employs the Jones infinitesimal calculus method in the optical DUT 30. In order to employ the Jones infinitesimal calculus method for determining the polarized mode dispersal in the optical DUT 30, it is necessary to know the polarizing state of the light ray lin each of the two wavelengths to be transmitted to the optical DUT. Additionally, the light

source 40 may be any one of optical energy sources to generate the light ray I in each of the two wavelengths. The light ray to be generated by the light source may have any polarizing state. Further, the light ray to be generated by the light source may include a nonlinear polarized light such as an elliptical polarized light or the light ray which is not polarized, since the polarizing state of the light ray, which is generated from the light source 40 by the polarized synthesizer 50, is capable of being identified securely when the light ray l is emitted from the polarized synthesizer. However, in the case that the light source 40 generates the light ray, which is linearly polarized, in each of the two wavelengths, the light source is selected and the polarized synthesizer 50 is sequentially set in such a manner as follows. In other words, the light ray should not be filtered completely (namely, be deleted) by one of settings of the polarized synthesizer depending on the polarizing state of the light ray to be generated from the light source. According to an example of the method of the present invention for determining the polarized mode dispersal in the optical DUT 30, the polarized synthesizer 50 is sequentially set to the three predetermined polarizing states. As a result of that, the light ray 1 to be transmitted to the optical DUT in each of the two wavelengths is capable of having the three predetermined polarizing states in each of the wavelengths as shown by a reference numeral 60 in Fig. 8. For example, the polarized

5

10

15

20

25

synthesizer 50 can be set so as to generate sequentially a linear polarizing state at 0 degree, 60 degrees and 120 degrees. Since the polarizing states are identified and these polarizing states are linear, it is possible that the three Jones vectors of the input optical electric field are satisfied in each of the wavelengths as shown by step 60 in Fig. 8.

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平5-273082

(43)公開日 平成5年 (1993) 10月22日

(51) Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号 FI

技術表示箇所

G01M 11/02

N 8204-2G

G01J 4/04

Z 8707-2G

審査請求 未請求 請求項の数3 (全 17 頁)

(21)出願番号 特願平5-32861

(22)出願日

平成5年 (1993) 1月28日

(31) 優先権主張番号 829. 994

(32)優先日

1992年1月31日

(33)優先権主張国

米国 (US)

(71)出願人 590000400

ヒューレット・パッカード・カンパニー アメリカ合衆国カリフォルニア州パロアル

ト ハノーバー・ストリート 3000

(72)発明者 ブライアン・エル・ヘフナー

アメリカ合衆国カリフォルニア州レッドウ

ッドシティ・ハドソンストリート925

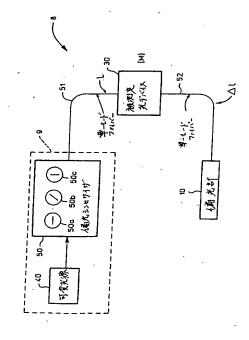
(74)代理人 弁理士 長谷川 次男

(54)【発明の名称】光装置の偏光モード分散判定装置および方法

(57)【要約】

【目的】 光線の異なる偏光状態を生成し、且つ検査中の光学装置による光線への作用によって生ずる偏光状態を測定することによって光学装置における偏光モード分散を判定する。

【構成】 <u>偏光光源9で、少なくとも2つの波長毎に、3つの偏光状態を光線に順次生成し、上記光ネットワークに各波長で上記3つの偏光状態を備えた上記光線を入射させ、偏光計10で、各波長毎の上記3つの偏光状態毎の上記光ネットワークの作用によって生成された偏光状態を測定し、上記偏光計によって測定された偏光状態から偏光モード分散を計算する。</u>



【特許請求の範囲】

【請求項1】光ネットワークの偏光モード分散判定装置 において

少なくとも2つの波長毎に、3つの偏光状態を光線に順次生成し、上記光ネットワークに各波長で上記3つの偏光状態を備えた上記光線を入射させる偏光光源手段と、上記光ネットワークによって伝送され、および光装置から反射された各波長での上記光線の3つの偏光状態のそれぞれの部分に反応し、各波長毎の上記3つの偏光状態毎の上記光装置の作用によって生成された偏光状態を測 10 定する偏光計と、

上記偏光計によって測定された偏光状態から偏光モード 分散を計算する手段と、

からなることを特徴とする光ネットワークの偏光モード分散判定装置。

【請求項2】光ネットワークの偏光モード分散判定装置 において、

少なくとも2つの波長毎に、3つの偏光状態を光線に順次生成し、上記光ネットワークに各波長で上記3つの偏光状態を備えた上記光線を入射させる偏光光源手段と、上記光ネットワークによって伝送され、および光ネットワークから反射された各波長での上記光線の3つの偏光状態のそれぞれの部分に反応し、各波長毎の上記3つの偏光状態毎の上記光ネットワークの作用によって生成された偏光状態を測定する偏光計と、

上記偏光計によって測定された偏光状態から偏光モード 分散を計算する手段と、

からなり、上記偏光計は、

波長毎の光軸を備えた上記光線の3つの偏光状態のそれ ぞれを受光、透過し、上記透過光線の強度分布を上記光 軸に関しほぼ均一にする光空間フィルタと、

上記透過光線を4つに区分する手段と、

上記区分された光線の内、第一の光線の通路上に位置 し、該光線に偏光を与える第一の光素子と、

上記区分された光線の内、第二の光線の通路上に位置 し、該光線に偏光を与える第二の光素子と、

上記区分された光線の内、第三の光線の通路上に位置 し、該光線に偏光を与える第三の光素子と、

4 つの光検出器であって、各光検出器は、上記区分された4 つの光線のいずれか一つの光線を受光し、該光線の強度の信号を検出するものと、

上記光検出器によって検出された信号から入射光線の偏 光を計算する手段と、

からなることを特徴とする光ネットワークの偏光モード 分散判定装置。

【請求項3】被測定光デバイスの伝送・反射応答の一つに基づいて偏光モード分散を判定する方法において、 光電子領域における各波長毎の3つのジョーンズ入力ベクトルに対応する少なくとも2つの波長毎に順次決定された3つの偏光状態を有する偏光光線を生成するステッ プと、

光デバイスに上記光線を入射させるステップと、

上記光線を4つに区分し、該区分された光線の内3つの 光線を光累子に通過させ、かつ4つのすべての光線の強 度を測定することによって、波長毎に順次決定された3 つの偏光状態毎に、上記光線に対する光デバイスの伝送 反射応答の一つを測定するステップと、

上記強度の測定結果からストークスパラメータを計算するステップと

10 上記ストークスパラメータを光電子領域におけるジョーンズ出力ベクトルに変換するステップと、

各波長毎の上記ジョーンズ入出力ベクトルから上記光デバイスの複案定数内までジョーンズマトリクスを計算するステップと

上記マトリクスから光デバイス内で偏光モード分散を計 算するステップと、

からなることを特徴とする偏光モード分散を判定する方法。

【発明の詳細な説明】

20 [0001]

【産業上の利用分野】本発明は光線の偏光状態を測定するための電子機器の分野に関し、特に検査中の光学装置(すなわち光学系、サブシステム又は部品)による入射光線の偏光状態を検出可能な前記の機器に関する。特に、本発明の一実施例は検査中の光学装置の異なる偏光状態に対する応答特性を確認することによって、光学装置における偏光モード分散を判定するために、検査中の光学装置に所定の波長と偏光状態を有する光線を入射させる方法と装置を提供するものである。

30 [0002]

【従来の技術】光学装置がより複雑になり、例えば光フ ァイバ・テレコミニュテーションにおいて光学装置への 用途が急増すると共に、光学装置の特性を正確に測定す ることが一層重要になっている。光入力及び光出力を有 する任意の光学装置の基本的な仕様は偏光分散である。 分散とは光パルスが光透過媒体を伝播する際に、光パル スが時間の経過と共に拡散する傾向を示す基本用語であ る。幾つかの種類の分散は光ファイバで測定することが できる。例えば、色分散が生ずる原因は異なる波長の光 40 が異なる速度で進行し、その結果、有限スペクトルの光 周波数から成るパルスが光ファイバに沿った伝播により り、時間の経過と共に次第に鮮鋭ではなくなることによ るものである。同様にして、偏光モード分散が生ずる原 因は、異なる偏光が異なる速度で進行することがあるか らである。偏光モード分散によって光ファイバ透過リン クにおいて活用できる透過帯域幅が限定されることがあ

【0003】従来は偏光モード分散を測定する技術の一つには図1に示し、且つK. 望月、Y. 波平及びH. 若50 林著「長い単一モード・ファイバにおける偏光モード分

.

散の測定」(Elect. Lett. 1981 年17号、153-154 ページ)に記載されたミヘルセン干渉計に類似した装置が含まれる。結合長さが短い光源からの光線は鏡、偏光子及びビーム分割器を通して向けられ、それによって可変的な相対時間遅延を有する2つの直交偏光を備えた光線の発生が可能になる。これらの2つの偏光は装置の入力の周辺偏光状態と一致するように検査中の装置内に放射される。装置を出た光線は出力の周辺偏光状態の中間を向いた偏光子を通過し、その後で検出される。それによって2つの直交信号の間の相互相関が検出器における偏光干渉しまから明らかになる。検査中の装置における偏光モード分散によって最大可視度に対応する遅延のシフトが生じ、この時間シフトはエ PMDである。

【0004】しかし、この技術には幾つかの欠点がある。この技術が有効であるには偏光の基本状態を知るか、発見しなければならないが、装置はそれ自体では基本状態を探索しない。更に、結合長さが短いことが必要であることはスペクトルが広くなることを意味する。当該の検査装置の多くは波長によって強く左右される基本状態と▼ PMDを有しており、この技術を用いてこのような装置を簡単に測定することはできない。何故ならば、光源の結合長さが短いことが必要であることはスペクトルが広いことを意味するからである。

【0005】偏光モード分散の第2の測定技術には同調 可能な光源と、偏光計とが必要である。2つの参考文 献、N.S.ベルガーノ、C.D.ポール及びR.E. ワーグナー著「多数の縦モード・レーザを使用した長い 単一モード・ファイバにおける偏光分散の研究」(IE EEj. 光波技術., LT-5, 1987年1618-1622ページ) 及びD. アンドレシアーニ, F. カー ティ, F. マテラ及びB. ダイノ著「低い復屈折の地球 ファイバ・ケーブルにおける偏光の基本状態管のグルー プ遅延差の測定」(光学しetter. ,1987年1 2号、844-846ページ) に記載されているこれら の技術が図2及び図3にそれぞれ載録されている。 偏光 の出力状態が測定され、ポインケァー球上にディスプレ ーされる。光源が周波数範囲に亘って同調されると、偏 光の出力状態が球上の弧をトレースする。基本状態とで PMDとが周波数範囲に亘って全く一定であるものと想定 すると、周辺状態は弧の中心に、又、直径方向の反対側 に位置し、 τ PMD= α / Δ ω である。ここに α は Δ ω に よって分離された2つの偏光出力状態の間の弧であり、 αは偏光の2つの基本状態を結ぶ軸を中心にして測定さ ns.

【0006】この技術にも幾つかの欠点がある。この場合もこの技術が有効であるためには偏光の基本状態が発見されなければならない。基本状態を発見するには時間がかかり、自動化が極めて困難である。 マ PMDが特定の周波数区間に亘って小さいならば、トレースされた弧はその中心を示すには小さすぎ、この技術は利用できなく

なる。

【0007】C. D. ボール著「無作為モードの結合を利用した単一モード・ファイバにおける偏光モード分散の測定」(光学しetter.,1989年14号、523-525ページ)に記載の偏光モード分散を測定するための第3の技術には図4に載録されているような装置が含まれている。使用時には、単色計によって選択される光周波数の関数として光電流が測定される。上記の参考文献を引用すると、ボール氏は"〔偏光〕分散が定常的且つエルゴディックである場合は、透過スペクトルの極端の密度は全体的な平均遅延時間〈モ PMD〉と直接的に関連する。"このような想定のもとで、全体的な平均遅延時間は下記の数式(1)によって得られる。

[0008]

【数1】

$$\langle \tau_{\mu \omega} \rangle = \pi \lim_{\Delta \omega \to \infty} \frac{N}{\Delta \omega},$$
 (1)

【0009】ここにNは光電流と光周波数のプロットの 20 区間△ωで観察される極端の数である。この技術は偏光 モード分散が定常的且つエルゴディックである場合にしか適用できないという欠点を有している。これらの条件 は長い単一モード光ファイバにおける偏光モード分散を 測定する場合に満たされることが多いが、例えばピグテール絶縁体や集積光学素子のような素手への装置又は回路の場合に全般的に満たされる訳ではない。しかも、条件が満たされた場合でも、この技術は偏光の基本状態を示すものではなく、測定された〈ェ PMD〉の値における 分解能は低い。

【0010】最後に、C.D.ポール、N.S.ベルガ ーノ、R. E. ワーグナー及びH. J. シュルテ著「1 47Kmの海底光波ケーブルにおける偏光分散及び基本 状態」(IEEE J光波技術., LT-6、1988 年、1185-1190ページ) は図5に示した装置を 使用している。この装置は偏光制御装置が同調可能な光 源と検査中の装置、この場合は147Kmのケーブルと の間に挿入されることを除けば、その機能の点では図2 及び図3に関して前述した技術と同一であることに留意 されたい。この文脈では、偏光制御装置は単一モードの 40 光ファイバのループ構造であり、これは手動調整してそ の偏光の変形を変更することができ、それによってユー ザーはループにより変更不能な偏光の度合いの制約の中 で、所望の任意の偏光状態をループの出力にて生成する ことができる。この点に関してはH. C. ルフェーブル 著「単一モードのファイバ分数波装置及び偏光制御装 置」(Elect. Letter., 16号、1980年刊、778-780 ペー ジ)を参照されたい。

【 0 0 1 1 】 使用時には、光源は導関数 ds1/d ωの近似 値を測定するように同調され、ここに s 1 は検査中の装 〕 置の出力において偏光状態を表す正規化されたストーク

5

·ベクトルである。次に偏光制御装置は偏光の新たな出 力状態 s2を生成するように調整され、光源はds2/d ωの 近似値を測定するように正確に同じ範囲に亘って再同調 される。偏光モード分散の所望の特性は下記の数式(2) から得られるベクトル q から導出することができる.

[0012]

【数2】

$$Q = \frac{\frac{dS_1}{d\omega} \times \frac{dS_2}{d\omega}}{\frac{dS_1}{d\omega} \cdot S_2} . \tag{2}$$

【〇〇13】出力周辺状態を表す正規化されたストーク ・ベクトルpはP= ±q/lql、及びモ PMDlqlに よって得られる。しかし、この技術にはs1又はs2が出力 周辺状態の一つに近く、又方程式(2)での相互積の値が 小さい場合はqの計算に大きい誤差が生ずるという欠点 がある。従って、例えば光学装置の設計中に異なる偏光 状態への光学装置の応答特性をアクセスできるように、 検査中の光学装置における入射光線の種々の偏光状態へ の偏光モード分散の判定を促進する方法と装置が必要で ある。更に、このような偏光モード分散の判定は校正さ れ、正確且つ迅速に達成できると共に、実施が簡便であ ることが望ましい。

[0014]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は光学装 置における偏光モード分散を判定できるように、光線の 異なる偏光状態を生成し、且つ検査中の光学装置による 光線への作用によって生ずる偏光状態を測定することが できる機器を提供することである。 本発明の別の課題は 波長の大部分の範囲に亘ってこのような偏光モードを判 定する機器を提供することである。 本発明の更に別の課 題は、測定システムにおける不都合な分散的な要素の作 用の校正が簡便な、偏光モード分散を判定するための機 器を提供することである.

[0015]

【課題を解決するための手段】本発明の一実施例は偏光 された光源を使用して検査中の光学装置における偏光モ ード分散を判定する方法と装置を提供するものであり、 前記光源は各々の波長毎に少なくとも2つの光波長と、 少なくとも3つの偏光状態とを有し、且つ偏光計を備え ている。本発明の一実施例に従った方法は、3つのジョ ーンズ入力ベクトルに対応する3つの連続する偏光状態 の第1の光波長を有する光線を供給し、第1の光線を光 学装置に入射させ、透過、又は反射した光線の偏光状態 を測定することによって、試験中の光学装置の第1の入 射光線に対する応答を測定するものである。この偏光状 態は透過、又は反射した光線を4つの光線に分割し、そ のうちの3つの光線を光学素子を通して通過させ、且つ 光検出機構によって4つの光線全ての輝度を測定するこ

とによって測定可能である。次にこのプロセスが第2の 光波長を有する第2の入射光線において反復される。次 に上記の測定結果からストークのパラメタが計算され、 ジョーンズの出力ベクトルへと変換される。次に検査中 の光学装置でのジョーンズ・マトリクスが各々の波長に て複素定数内で計算される。その後、これらのマトリク

6

スから検査中の光学装置における相対的偏光モード分散 を判定することができる。

【0016】光源は偏光シンセサイザに接続されること が好ましく、このシンセサイザは、光源によって生成さ れる異なる波長を有する光線の各々の偏光状態を3つの 周知の偏光状態、例えば水平、6.0度、及び120度の 直線偏光状態に順次変換するために使用される。偏光の 3つの状態は強度が同じである必要はない。 偏光シンセ サイザによって作成された光線は未知のジョーンズ・マ トリクスを有する検査中の光学装置に送られる。光線は 検査中の光学装置に入射され、各々の光線の透過、又は 反射部分は偏光状態を測定する偏光計に向けられる。偏 光計は光出力を測定する必要はない。検査中の光学装置 は開放光線内に配置することができる。あるいは、単一 モード光ファイバで接続することもできる。

【0017】偏光計では、受光された光線の部分は4つ の光線に区分され、3組の光学素子によって処理され る。第1の光学素子は水平直線偏光子であり、第2の光 学素子は第1の光学素子に対して光軸を中心に45度の 偏光方向を有する直線偏光子であり、第3の光学素子は 円形の偏光子である。第4の光線の測定によっ そ全入射 強度と比例する正規化係数が得られ、それによって4つ の全てのストーク・パラメタの判定が可能になる。2つ 30 の光線の各々の受光部分は空間的フィルタとして機能す る単一モード光ファイバを経て偏光計に入る。 前記空間 的フィルタは他の光学素子と並んで偏光計内の光線の受 光部分の位置と調心とを制御する。

【0018】各々の光線毎に偏光シンセサイザによって 生成される判明した3つの順次の入力偏光状態は各々の 光線毎に3つのジョーンズ入力ベクトルを生ずる。各光 線の3つの順次の偏光状態のそれぞれに対する光学装置 の応答のストーク・パラメタは対応する3つのジョーン ズ出力ベクトルに変換される。次に検査中の光学装置の 40 各光線に応答するジョーンズ・マトリクスがジョーンズ 入力及び出力ベクトルからの複素定数内まで計算され る、最後に、検査中の光学装置についてのこれらのマト リクスから偏光モード分散を判定することができる。 [0019]

【実施例】本発明に従って校正され、正確且つ簡便な偏 光モード分散の判定を達成するための機器の一実施例が 図6に参照番号8を付して全体的に示されている。機器 8は光線1を検査中の光学装置(DUT)30へと送る ための偏光された光源9と、DUTによって透過される

光線1の部分を受光する偏光計10とを備えている。実

20 3.

8

際には、偏光された光源9は光源40と、図6において前記の衆子の周囲に点線で示した偏光シンセサイザ50とから成ることができる。例えば、光源40は1300ナノメーターと、1302ナノメーターのような異な所定の波長の光線を生成する単数又は複数の固体レーザであることができる。これらの波長は例えば同調可能なレーザを用いて達成可能であり、あるいは広いスペクトルを有するレーザ又はその他の光源と、波長を選択する単色計とを用いて達成できる。概念的には、本発明に従った偏光モード分散の判定は2つの連続する光線を用いて説明される方が理解し易いが、広いスペクトルの波長を有する光線でDUT30を同時に照明するために広いスペクトルの光源を使用することができる。何れかの位置で単色計を使用することができる。

【0020】3つの異なる偏光子50a,50b及び50cを光源40によって発生される光線の経路内に挿入し、光線1の3つの順次の偏光状態を生成するために、偏光シンセサイザ50は自動化されることが好ましい。偏光子50a,50b及び50cは直線的な偏光状態を透過することが好ましいが、あるいは楕円形の偏光状態を透過するようにも選択することができる。可変又は回転周波板を含む別の偏光発生器を使用することもできる。

【0021】図7に示すように、図6に示したDUT3 0によって透過される光線△1の部分は光線の空間的フィルタリングを行う単一モード光ファイバ11を経て偏 光計10に入る。判明している偏光のわずかに2つの基準光線を使用することによる、入力光ファイバ11に起 因する偏光状態の歪みを修正するための校正方法は19 91年9月6日に出願され、本件出願人に譲渡され、その内容の全体が本明細書に参考文献として組み込まれている係属中の米国特許出願連続コード/連続番号第07 /755、931号に記載されている。

【0022】光学偏光計10は入力光ファイバ11がその範囲に亘って単一モードの伝播を支持する波長の範囲で動作することができる。例えば、コーニング・グラス社製の1.3ミクロンの透過用の標準型の長距離テレコミニュケーション用ファイバは1.2-1.6マイクロメーターの波長範囲に亘って単一の伝播モードを支持することができる。

【0023】光線△Iは独自に移動できる象限12a, 12b,12c,及び12dへと区分された集束おう面 鏡12へと進行する。偏光計10の効率と精度は入力光 ファイバ11の空間的フィルタリング機能によって増強 され、前記の入力光ファイバによって光線△Iは確実に 象限12a-12dの間に反復的に配分される。集束お う面鏡12は図7に示すように光線を4つの別個の光線 へと分割する。4つの光線はそれらの経路に異なる光学 素子を配置できるように充分に分離される。これらの光 線は"△la", "△lb", "△lc"及び、"△l d"と呼ばれる。

【0024】 "△1b" の符号を付した光線は水平の偏

光軸を有する直線偏光子14を通過する。光線 "△lc" は直線偏光子14に対して光軸を中心に45°だけ

角度を持つ偏光軸を有する直線偏光子15を通過する。

光線 "△I d"は1/4波板17を通過し、その後で直線偏光子15と同じ方向を向いた直線偏光子16を通過する。この組合せは円形偏光子である。最後に、光線 "△I a"はその経路に光学素子を有していない。 【0025】4つの光線 "△I a" — "△I d"はそれぞれの光検出機構18、19、20又は21に入射し、ほぼ吸収される。各光検出機構18—21は吸収された光エネルギの強度に比例する電気信号を生成する。光検出機構18は振幅Tの信号を生成し、光検出機構19は信号Fを生成し、光検出機構20は信号Fを生成し、光検出機構21は信号Cを生成する。偏光計10の測定周波数は光検出機構18—21の周波数応答によってのみ限定され、これは1GHzを容易に超えることができ

【0026】集束おう面鏡の各象限12a-12dは場 合に応じて直接的に、又は光学素子14-17を経て前 記おう面鏡に入射する光線△1を対応する光検出機構 1 8-21に集束するように調整される。鏡の象限部分1 2a-12dの調整機構は、本発明の分野の専門家には 容易に構成できるので図示しない。光検出機構18-2 1によって作成される電気信号はアナログーディジタル 変換回路を有するマイクロプロセッサ27に伝送され る。光検出機構18-21によって作成される電気信号 30 の振幅は図6に示したDUT30によって透過される光 線△1の部分のストーク・パラメタを判定するために利 用することができる。本明細書の説明目的で、ストーク ·パラメタの定義はM.ボーン及びE.ヴォルフ著の公 知の論文「光学の原理」(パーガモン・プレス第4版、 ロンドン、1970年刊、30-32ページ)に基づく ものである。これらのパラメタは符号"so"、"s1 ""s2"及び"s3"で示され、光学案子14-1 7の周知の構造と、光検出機構18-21によって測定 された強度に基づくこれらの4つの数量の全ての仕様が 光線△【の偏光状態を決定する。光検出機構18-21 によって生成される電気信号T、H、F及びCは下記の 方程式によるストーク・パラメタに関連するものであ

(3)

[0027]

【数3】

 $s_0 = T$;

[0028]

50 【数4】

$$s_1 = 2H - T; \tag{4}$$

[0029]

【数5】

$$s_2 = 2F - T; (5)$$

[0030]

【数6】

$$s_3 = 2C - T.$$

【0031】ストーク・バラメタsoは単に全光線強度 である。ストーク・パラメタs1、s2及びs3は方程 式(4) - (6) を用いて光検出機構18-21によって生 成される電気信号から定められる。偏光の度合いは次の 方程式によって表される.

(6)

[0032]

【数7】

$$D = \frac{\sqrt{s_1^2 + s_2^2 + s_3^2}}{s_0}. \tag{7}$$

【0033】このような計算は図7に示したマイクロプ ロセッサ27によって自動的に行うことができる。本発

$$\phi(\omega) = \phi(\omega_0) + \frac{d\phi(\omega_0)}{d\omega}(\omega - \omega_0) + \frac{d^2\phi(\omega_0)}{d\omega^2}(\omega - \omega_0)^2 + \dots$$
 (7-1)

【0036】ここにφ(ω)の導関数は見積もられる前 にω0で導出される。ω0からの変化が小さい場合は、 下記の一次近似式が適用される。

【0037】ここに d φ / d ω にはグループ遅延の名称 が与えられ、てgの項が置き換えられる。グループ遅延 は場合によっては伝播遅延とも呼ばれるが、その理由 は、それが当該の回路網又は装置をパルスが伝播する際

明に従った偏光モード分散を判定する方法は任意の光学 系に適用される。以下の説明上の目的で、図6に示した DUT30における偏光モード分散の判定をDUTを通 る光線」の透過の測定に限定して説明する。あるいは、 透過の測定の代わりに、後に簡略に説明するように光線 分割器又は指向性結合器を用いて反射の測定を行うこと

10

【0034】背景として、偏光が問題ではないマイクロ 波回路網、及び偏光が変化しないことが判っている回路 網では、信号をベクトルではなくスカラとして表すこと ができる。この場合は、直線の、時間不変装置又は回路 網は複合周波数応答H(ω)によって特徴付けられ、こ れは入力周波数スペクトルχ(ω)を出力スペクトルッ (ω) と関連付けて、 $y(\omega) = H(\omega) x(\omega)$ とな るようにする。周波数応答の大きさと位相はΗ (ω) = σ (ω) exp $\{i\phi(\omega)\}$ と表記することによって 分離することができ、ここにσとφはωの実関数であ る。φはωοに関するテイラー級数において下記のよう に拡張することができる。

[0035] 【数8】

に、ωοに近い周波数成分から成るパルスに起因する時 間遅延であるからである。入力スペクトルが周波数範囲 に亘って一定である特別な場合には後に利用され、x $(\omega) = \mathbf{x} (\omega + \Delta \omega) となり、且つ、$

30 [0038]

【数9】

$$H(\omega) = \sigma(\omega) \exp\left[i\phi(\omega_0) + i\tau_g(\omega - \omega_0)\right], \tag{8}$$

【0039】となる。時間遅延が位相変化の支配的な機 構である装置と回路網では、方程式(8)と(9)の近似計 算はΔωが大きい場合でも妥当である。更に別の背景と して、光学系における偏光特性の処理のための有効且つ コンパクトな定式が1941-1956年の間にR. C. ジョーンズによって導入された。ジョーンズ、R. C著「光学系処理のための新しい微積分学。(1) 微積分 学の解説と検討」(J. 光学協会、AM., 31、1941 年488-493ページ)「光学系の処理のための新し い微積分学。(2)3つの基本的等価定理の証明」(J. 光学協会、AM,31、1941年493-499ペー ジ)「光学系の処理のための新しい微積分学。(3)光学 的作用のSohncke理論」(J. 光学協会、AM,3 1、1941年500-503ページ) 「光学系の処理 のための新しい微積分学。(4) (J. 光学協会、AM, 3

2、1942年486-493ページ) 「光学系の処理 のための新しい微積分学。(5)より基本的な定式と別な 微積分学の解説」(J. 光学協会、AM,37、1947 年107-110ページ)「光学系の処理のための新し 40 い微積分学。(6) マトリクスの経験的な判定」(J. 光 学協会、AM,37、1947年110-112ページ) 「光学系の処理のための新しい微積分学。(7) N-マト リクスの特性」(J. 光学協会、AM.,38、1948年 671-685ページ)「光学系の処理のための新しい 微積分学。(8) 電磁理論」(J. 光学協会、AM. 46、 1956年126-131ページ)を参照されたい。ジ ョーンズの微積分学の概要はクリガー、D.S.、ルイ ス、J.W.:及びランダール、C.E.著「光学及び ステレオスコピーにおける偏光光線」(アカデミック出

版、サンディエゴ、1990年刊)の第4章に記載され

ている.

【0040】一般に、ジョーンズは未知の、直線的な、時間不変の光学装置の順方向透過マトリクスMを経験的に判定するための明確な数式を導入した。(ジョーンズ、R. C著「光学系処理のための新しい微積分学。(6)マトリクスの経験的な判定」(J. 光学協会、AM、37、1947年110-112ページ)このような限定は入射光線の光学的周波数とは異なる新たな光学的周波数を生成する光学装置を排除するものである。更に、ジョーンズ・ベクトルは部分的に偏光したフィールドを表すために用いることができない。しかし、光源からの光線は直線偏光子によって完全に偏光されることができるので、このことは実質的な制約にはならない。更に、ジョーンズのマトリクスはDUTの偏光の消滅を表すことができない。しかし、偏光の消滅作用は充分に長い結合長さを有する準単色の光源を仕様することによって除

$$y(\omega + \Delta \omega) = \frac{H(\omega + \Delta \omega)}{H(\omega)}y(\omega) = \frac{\sigma(\omega + \Delta \omega)}{\sigma(\omega)}e^{i\tau_{\sigma}\omega}y(\omega).$$
 (9)

【0043】光学DUT30のような光学DUTは複合的2×2の行列によって表される。入力光学電界における光学DUTの作用は光線△1の透過部分を表す出力電界ベクトルを得るために電界ベクトルと光学DUTを表す行列とを乗算することによって見出される。光学電界の全位相のトラックを保持するためには、透過行列Hat M (記号Mの上に の記号を有するもの。以下、同様)を利用することが必要である。このHat Mは光学DUT30を経た任意の位相遅延の作用を備えている。この場合もHat Mの測定は困難であるが、それは干渉計を使用する必要があるからである。一方、相対的な位相情報だけを含む切捨てされたジョーンズ・行列Mの測定は比較的簡単である。ジョーンズ・ベクトルの場合のように、行列Hat MとMとの相関は光学位相項によって表される

[0044]

【数11】

 $\hat{\mathbf{v}} = e^{i\theta} \mathbf{v}$.

(10)

【0045】一般に、光学装置又は回路網を表すジョーンズ・行列は光学ラジアン周波数 $\omega=2\pi c/\lambda$ の関数であることができ、ここにcは光線の速度であり、 λ は波長である。下記の方程式 (12)で表されるように、光学

 $\theta_{out}(\omega) = \hat{M}(\omega) \theta_{in}$ and $v_{out}(\omega) = M(\omega) v_{in}$. (12)

【0049】ここに全体としてk=1、2であるものと想定されている。方程式(9)が満たされる場合は、z1及びz2は偏光の入力基本状態と呼ばれ、w1及びw2は偏光の出力基本状態と呼ばれる。偏光の出力基本状態は2つのグループ遅延zg、1及びzg、2と関連し、これは偏光の出力基本状態の絶対位相zkは周波数に応じて変化すること、すなわちzdzezg、zkである

去することができる。

√【0041】上記のような制約があるものの、ジョーンズの微積分学は、図6に示した光線しのような光線の位相と状態を完全に特定する1×2の複合した段の電界ベクトルHat v (記号 V の上に の記号を有するもの。以下、同様)によって入力光学電界を表すことができる。このベクトルの2つの複合要素は光学電界の×及び y 成分の振幅と位相をそれぞれ表す。2つの光学的位相の測定は、光学的干渉計が必要であるので困難であるが、×とy線分の間の相対的位相の測定は比較的簡単である。相対的な位相情報だけを含むジョーンズ・ベクトルは切捨てたジョーンズ・ベクトル v と呼ばれる。Hat v と v は光学的位相項によって関連している。すなわち、下記のような角度θが存在する。

12

[0042]

【数10】

20 装置又は回路網がジョーンズ・行列の周波数に準拠していることによって、出力ジョーンズ・ベクトルを導出することができ、これは入力ジョーンズ・ベクトルが一定に保たれている場合でも、光学周波数が変化すると変化する。

[0046]

【数12】

$$\hat{M} = e^{i\theta} M.$$

(11)

【0047】偏光が原因である損失を呈する任意の回路 30 網にとって、2つの入力ジョーンズ・ベクトル Z k があることが判明しており、その結果、出力ジョーンズ・ベクトルw k = M (ω) Z k (k=1、2の場合) は光学周波数の小さい範囲に亘って第1次まではωに左右されない。C.D.ボール、R.E.ワーグナー著「長い単ーモード・ファイバにおける偏光分散に対する現象的アプローチ」(Electlett.,22、1986、1029-1030ページを参照のこと。)w k において第1次周波数依存性が欠如していることは、次のように表される。

40 【0048】 【数13】

> ことを意味している。偏光の入力及び出力状態は一般に 光学周波数の関数である。偏光モードのグループ遅延差 τ PMD = | τ 1 - τ g2 | も基本的には光学周波数の関数 である。光学DUT30での偏光モードを判定するため の本発明に従った方法の一実施例は、2つの波長のそれ ぞれで出力光学電界を導出するために必要な光線△1の 透過部分の強度測定を行い、且つ入力及び出力ジョーン

ズ・ベクトルから光学DUT30用のジョーンズ・行列 を計算し、2つの波長のそれぞれにおける3つの判明し ている偏光状態についての入力光学電界のジョーンズ・ ベクトルを満たすことに基づくものである。その後で、 本発明の方法は計算されたジョーンズ・行列から光学D UT30における偏光モード分散を判定する。それによ って、光学DUT30における偏光モード分散の正確な 判定が可能であると共に、実行しなければならない実際 の測定回数を減らすことができ、従って迅速且つ簡便で ある、次に本発明の偏光モード分散の判定方法をより詳 細に説明する。本発明に従った方法の一実施例は2つの 波長のそれぞれにおいて光線1の3つの連続的な周知の 偏光状態に応じて図6に示した光学DUT30の透過の 偏光モード分散を判定するものである。光源40の出力 は偏光シンセサイザ50の入力に接続され、この偏光シ ・ンセサイザは2つの波長のそれぞれにおいて光源40に よって発生される光線の偏光状態を、3つの所定の順次 的な偏光状態、例えば水平、60°、及び120°の直 線偏光へと変換するために使用される。偏光の3つの状 態は同じ強度である必要はない。

13

【0050】偏光シンセサイザ50の出力は光学DUT30の入力に接続される。光学DUT30は2つの波長のそれぞれにおいて未知の透過ジョーンズ・行列を有している。後に示すように、光学DUT30における偏光モード分散は行列を定めた後はこのジョーンズ・行列から判定することができる。本発明の方法に従って、未知のジョーンズ・行列は2つの波長のそれぞれにおける光線1の所定の順次的な偏光状態に対する光学DUT30の応答の測定(ストーク・パラメタの測定)から計算される。

【0051】より詳細に考察すると、光学DUT30に おいて偏光モード分散を判定する方法の一実施例が図8 に示されている。上記の図に示すように、光学DUT3 0 において 偏光モード分散を判定する本発明の方法の一 実施例はジョーンズ微積分法を利用している。光学DU T30において偏光モード分散を判定するためにジョー ンズ微積分法を利用するには、光学DUTに送られる2 つの波長の各々における光線1の偏光状態を知ることが 必要である。しかも光源40は2つの波長の各々におい て光線しを発生する任意の光学的エネルギ源のいずれで もよく、光源によって発生される光線は任意の偏光状態 を有することができる。それには、楕円状に偏光した光 線のような非直線的に偏光した光線、又は偏光しない光 線が含まれる。その理由は、偏光シンセサイザ50によ って、光源40から発生された光線は、光線」が偏光シ ンセサイザを出る時にその偏光状態が確実に判明するか らである。しかし、光源40が2つの波長の各々で直線 的に偏光した光線を発生する場合は、光源の選択と、偏 光シンセサイザ50の順次のセッティングは次のように 行わなければならない。すなわち、光源により発生され

る光線の偏光状態によって、偏光シンセサイザのセッティングの一つにより光線の完全なフィルタリング(すなわち消去)が行われないようにされなけばならない。光学DUT30において偏光モード分散を判定するための本発明の方法の一実施例に従って、偏光シンセサイザ50は3つの所定の偏光状態に順次設定され、その結果1は図8の参照番号60で示すように、各々の波長で3つの所定の偏光状態を有することができる。例えば、偏光シンセサイザ50は0°、60°及び120度で直線的な偏光状態を順次生成するようにセットすることができる。偏光状態が削明しているので、又、それらの偏光状態が直線的であるので、3つの入力光学電界のジョーンズ・ベクトルは図8の段階60で示すように各々の波長において満たされることができる。すなわち、

[0052]

【数14】

$$\frac{dw_k}{d\omega} = \frac{dM(\omega)}{d\omega} z_k = 0, \qquad (13)$$

20 【0053】ここに、i=1、2は2つの波長に対応し、j=1、2、3は偏光シンセサイザ50の3つの順次的な設定に対応し、θijは目下の設定における偏光状態に対応した角度である。2つの波長の各々での順次の3つの所定の入力偏光状態を有する光線1は、図8の参照番号62で示すように大気(開放光線)を経て、又は光ファイバ51を経て光学DUT30に送られる。光学DUT30は2つの波長の各々での順次の3つの所定の入力偏光状態の各々の設定により生成される光線1の偏光状態に作用する。

30 【0054】前述のように、光学DUT30における偏 光モード分散は、光学DUTの偏光が消去されている場 合はジョーンズ微積分を用いて正確に判定することはで きない。しかし、光学DUT30の偏光の消去による作 用は極めて狭い幅のスペクトル線を用いることによっ て、すなわち、充分に長い結合長さの準単色の光源をも ちいることによって、又は単色計と組み合わせた広いス ペクトルの光源40を用いることによって除去すること ができる。光学DUT30の偏光モード分散は方程式(1 4)によって得られる3つの順次的な判明している入力電 40 界ジョーンズ・ベクトルと、下記のように2つの波長の 各々における3つの所定の順次的な入力偏光状態に対す る光学DUTの、測定された3つの応答とから判定する ことができる。光学DUT30を通した透過の場合は、 2つの波長での偏光シンセサイザ50により生成された 光線」のそれぞれの偏光状態は光学DUTに入射する。 その結果として生ずる2つの波長の各々での光線△1の 部分の偏光状態は光学DUT30を順次出で、開放光線 又は光ファイバ52を経て偏光計10に送られる。図8 の参照番号64で示されるように、光学偏光計10は前 述のとおりストークのパラメタを測定し、それから光学

DUT30により生成された光線△lの3つの順次的な 偏光状態のそれぞれを計算することができる。

【0055】光学偏光計10は偏光計によって受光された光線△1の3つの順次の偏光状態のストーク・パラメタを測定し、図8の参照番号66によって示すように、対応するストーク・ベクトルを計算する。これは2つの

$$q_{ij} = \begin{bmatrix} \cos \theta_{ij} \\ \sin \theta_{ij} \end{bmatrix},$$

【0057】ここに、i=1、2は2つの波長に対応 し、j=1、2、3は偏光シンセサイザ50の3つの順 次的な設定による光線△1の3つの順次的な設定に対応 する。この行列は光学素子14-17の存在によって規 定される偏光計10の機器の行列であり、H、T、C及 びFは光検出機構18-21により生成される電気信号 である。実際には、機器行列は光学素子14-17の不 完全さと、光検出機構18−21の間での光線△1の一 様ではない分布の結果、方程式(15)に示したものと異な る場合があり、従って判定されなければならない。ジョ ーンズ微積分は光学電界のx及びy成分の間に相対位相 情報が存在する場合に限り光学DUT30の偏光モード 分散を判定するために利用できる。 偏光モード分散を判 定するための本発明の方法はストーク・ベクトルSij が光学電界の×及びy成分の間に相対位相情報が含まれ ることを認識する。従って、ストーク・ベクトルは図8 の参照番号68に示すように2つの波長の各々での偏光 シンセサイザ50の3つの順次的な設定の各々について 出力電界のジョーンズ・ベクトルへと変換されることが できる。これは前述の米国特許連続出願コード第07/ 755、931号に記載されているとおりである。更 に、前述の米国特許連続出願コード第07/755、9 31号に記載されているとおり、図8の参照番号70に 示すように所望の行列Mを計算することができる。

【0058】測定はノイズと僅かな合成誤差を伴って行われることを考えると、行列Mの最も正確な計算は、2

波長の各々における光線△lの各々の受光された偏光状態毎に図7に示す信号H、T、C及びFを測定することによって達成される。3つの順次的な所定の入力偏光状態におけるストーク・ベクトルは下記のとおりである。 【0056】

16

【数15】

(14)

10 つの波長の各々での所定の3つの順次的な入力偏光状態 が互いにポインケァ球上で互いにできる限り離れている 場合に可能になる。それによって、偏光の3つの順次的 な入力状態の下記のような好ましい選択ができる。楕円 の偏光状態を生成するよりも、任意の波長での直線的な 偏光状態を生成するほうが容易であるので、偏光の入力 状態は3つの直線的な偏光子をほぼ偏光状態が消去され ているか、又は円形に偏光されている光線へと連続的に 挿入することによって生成することが好ましい。それに よって偏光の3つの順次的な入力状態の出力はほぼ等し いものに制約され、最も正確な測定が達成される。従っ て、相対角度0°、60°及び120°での直線的な偏 光子50a、50b及び50cは、次のように選択され ることが好ましい。すなわち、ジョーンズ入力ベクトル Hat vinにより規定される3つの順次的な偏光入力状態 はポインケァ球上の大きい円上で120°の間隔を隔て てある。すなわちできる限り遠い位置にある。

【0059】次に本発明の方法の一実施例に従って行列 Mから光学DUT30での偏光モード分散の判定するこ とを理解するのに必要な一次代数による幾つかの技術を 30 簡単に説明する。n×nの行列をAとすると、下記の方 程式(16)である場合は、次元nの非ゼロ・ベクトル b は 固有値 c に対応するAの固有ベクトルであるということ ができる。

【0060】

$$S_{ij} = \begin{pmatrix} S_{ijo} \\ S_{iji} \\ S_{ij2} \\ S_{ij3} \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} H_{ij} \\ T_{ij} \\ C_{ij} \\ F_{ij} \end{pmatrix},$$

【0061】ルトリクスAの固有値Cnは特性方程式det (A-cI)=0の平方根によって得られ、ここにIはAと同じ次元の識別行列である。上記の方程式 (16)から、行列A = a Aは固有値acを有することが判り、 (ここにaは複素定数である。) 完全な偏光子ではない任意の光学装置又は回路網を表すジョーンズ・行列は単数ではない複合した 2×2 行列によって表すことができ、且つ、このような行列は 2 つの非ゼロ固有値 C1 及び C2 (基本的に複素数デアルガ、別個である必要は

ない。)を有することが判る。

【0062】ここで、図6に示した光学DUT30のような光学素子又は回路網における偏光モード分散を判定するために、同調可能な光源40が偏光シンセサイザ50の入力に接続される。このシンセサイザは光源によって生成される光線の偏光状態を、例えば水平、60°及び120度の直線のような3つの判明している偏光状態に変換するために使用される。偏光シンセサイザ50の出力は短い長さの単一モード光ファイバ51を経て光学

の場合は、一対の入力ジョーンズ・クトルが加えられ、

DUT30に向けられる。この光ファイバは無視できる範囲の偏光モード分散しか誘導しないものと想定される。光学DUT30の直線的な光学特性はジョーンズ・行列M(ω)によって表される。光学DUT30の出力は短い長さの単一モード光ファイバ52を通して偏光計に向けられる。この場合も光ファイバは無視できる範囲の偏光モード分散しか誘導しないものと想定される。あるいは、光学DUT30は偏光シンセサイザをでる光線はほぼ視準が合わせられて、光ファイバ導波管を用いる必要なく光学DUTを通って偏光計へと伝播するようにされる。

【OO63】所定の任意の光周波数ωnにおいて、偏光 シンセサイザ50は偏光の3つの刺激状態を生成し、偏 光計10はそれに対応する3つの応答状態を測定する。 前述の米国特許連続出願コード第07/755、931 号に記載されている技術を用いて、切捨てられたジョー ンズ行列M (ωn) は2つの波長の各々における前述の 測定に基づいて判定される。その結果、図8に示す段階 70で行列 Mを判定した後、図8に示す段階72で次の ように光学DUT30での偏光モード分散を判定するこ とができる。偏光の基本状態の概念を一般化して、偏光 によって透過が左右される光学装置又は回路網、すなわ ち装置又は回路網を透過する光出力が偏光の入力状態に 左右される光学装置又は回路網を含めることもできる。 偏光に左右されない透過の場合は、偏光の基本出力状態 2) によって表され、これは小さい範囲の光周波数に亘 る第1次まで周波数に左右されない。より一般的な偏光 に左右される損失又は利得を有する光学装置及び回路網

$$w_k(\omega + \Delta \omega) = \frac{\sigma(\omega + \Delta \omega)}{\sigma(\omega)} w_k(\omega)$$
 for $z_k(\omega + \Delta \omega) = z_k(\omega)$, (17)

【0068】方程式(18)と方程式(9)の類似性は明瞭であり、唯一の相違は方程式(18)が2つの出力基本状態のジョーンズ・ベクトルの性質を表していることである。このベクトノの各々はグループ遅延でg、1、又はで g、2を伴って回路網を通って伝播される。方程式(18)は入力

これは回路網を透過した後、出力ジョーンズ・ベクトルwk=M(ω) zk(k=1、2)を生成する。その方向は小さい範囲の光周波数に亘る第1次まで周波数に左右されない。(同じ方向での一群のベクトルは増倍定数内で全て同一である。)そこでzkとwkは一般化された基本的な偏光の入力及び出力状態であり、この場合も光周波数の関数である。小さい周波数範囲 $\Delta\omega$ に亘って出力ジョーンズ・ベクトルの方向が変わらないことは、次の方程式によって表される。

[0064]

【数17】

-cb = Ab. (10

【0065】ここに電界透過振幅 σ (ω)は ω の実関数であり、回路網が偏光に左右される損失又は利得を生ずる場合に起こり得る透過の変化を考慮したものである。方程式(17)によって表される一般化された偏光の基本状態も又、2群の速度 τ g、1、 τ g、2に関連する。すなわち、偏光の出力基本状態の絶対位相 ϕ k は次のように周20 波数と共に変化する。d ϕ k /d ω = τ g、k

【0066】方程式 (17) に絶対位相情報を付加するために、出力基本状態の光学的位相 w kが 周波数と共に変化する態様を示すために位相項を組み入れる必要がある。グループ遅延を定義することによって、この変化は exp[irg] k $(\omega-\omega 0)$ によって第 1 次まで表される。全ジョーンズ・ベクトル Hat w k (記号w0 上にの記号を有するもの。以下、同様)を用いて方程式 (17)次のように書き換えることができる。

[0067]

30 【数18】

- 出力関係 $Hat wk = Hat M(\omega) zk と組み合わせる ことができ、下記が得られる。$

[0069]

【数19】

$$\hat{\omega}_{k}(\omega + \Delta \omega) = \frac{\sigma(\omega + \Delta \omega)}{\sigma(\omega)} e^{i\tau_{\sigma,k} \Delta \omega} \hat{\omega}_{k}(\omega) \quad \text{for } \hat{z}_{k}(\omega + \Delta \omega) = \hat{z}_{k}(\omega) .$$
 (18)

【0070】ここで新たな一対の行列が定義される。 【0071】 【数20】

 $\hat{M}(\omega + \Delta \omega) \, \hat{Z}_{k}(\omega) = \frac{\sigma(\omega + \Delta \omega)}{\sigma(\omega)} \, e^{i\tau_{\sigma,k} \, \Delta \omega} \, \hat{M}(\omega) \, \hat{Z}_{k}(\omega) \, . \tag{19}$

【 0 0 7 2 】次に方程式 (19)に M ⁻¹を乗算すると次が得 【 0 0 7 3 】 られる。 【 数 2 1 】

$$\hat{H}'(\omega, \Delta\omega) = \hat{H}^{-1}(\omega)\hat{H}(\omega + \Delta\omega)$$
 and $M'(\omega, \Delta\omega) = M^{-1}(\omega)M(\omega + \Delta\omega)$. (20)

【0074】M (ω 、 $\Delta\omega$) zk (ω) は位相係数 θ によってM (ω 、 $\Delta\omega$) zk (ω) と相関し、この係数は ω と $\Delta\omega$ の双方の関数であるので、方程式(21)は次

【数22】

のように表すことができる。

$$\hat{R}^{I}(\omega, \Delta\omega) \,\hat{z}_{k}(\omega) = \frac{\sigma(\omega + \Delta\omega)}{\sigma(\omega)} \, e^{i\tau_{\sigma,k}\Delta\omega} \,\hat{z}_{k}(\omega) \,. \tag{21}$$

【0076】方程式(16)と比較すると、偏光の入力基本 状態 z k (ω) は下記の方程式によって得られる固有値 と関連する M $(\omega$ 、 $\Delta\omega$)の固有値であることが判

[0077]

[0075]

【数23】

$$M'(\omega, \Delta\omega) z_k(\omega) = \frac{\sigma(\omega + \Delta\omega)}{\sigma(\omega)} e^{i\{\tau_{\sigma,k} \Delta\omega + \theta(\omega, \Delta\omega)\}} z_k(\omega). \tag{22}$$

【0078】任意の複素数xはx=ae Ibの形式で表すことができ、ここにaとりは実数であり、bはxの独立変数であると定義することができる。すなわちArg [x]=bである。最後に、偏光モード分散のグループ遅延差 τ $PMD=|\tau g, 1-\tau g, 2|$ は $\Delta \omega$ とM (ω 、 Δ

ω) の固有値の独立変数とを用いて次のように表すこと ができる。

[0079]

【数24】

$$C_k = \frac{\sigma(\omega + \Delta \omega)}{\sigma(\omega)} e^{i(\tau_{g,k} \Delta \omega + \theta(\omega, \Delta \omega))}. \tag{23}$$

【0080】これは図8の参照番号72に示すとおりで ある。図6に示す光学DUT30のような光学装置又は 回路網における偏光モード分散を測定するために本発明 の方法を利用する際に、少なくとも2つの連続する光周 波数 ωn 、n=1、2・・Nにおいて光学装置DUTの ジョーンズ行列Μ' (ω)を測定するために図6にく示 した装置が使用される。 ω Π から ω Ω Ω をの光周波数の 範囲において、偏光の一般化された入力基本状態は固有 ベクトルM (ω Π 、 ω $_{n+1}$ - ω Π)によって表され、 偏光分散モードのグループ遅延差は方程式(24)によって 表され、ここにCkは同じ行列の固有値である。Nが2 以上である場合は、偏光の基本状態とグループ遅延差が 各々の連続する光周波数区間毎に判定され、従って入力 と出力の偏光基本状態の周波数依存性と、グループ遅延 差を直接的に判定することができる。各々の周波数毎の ジョーンズ行列が測定プロセスの一部として判定される ので、偏光の出力基本状態は簡単にwk,n=M (ωn)z k,nであるものと判明する。

【0081】偏光モード分散は透過測定の代わりに図9に示す計器を用いて反射測定によっても判定することができる。図9に示した素子9'、10'、30'、51'及び52'は図6に示した素子9、10、30、51及び52とそれぞれ対応している。唯一の相違点は光線1が指向性の光学結合器100によって光学DUT30に送られ、光線△1の一部が図6に示すように光学DUT30によって偏光計10へと透過されるのではなく、偏光計10'に送られる光線△1の一部が反射光線であることである。従って、透過と反射の双方の測定を、本発明に従った偏光モード分散を判定するための方法の範囲内にあるものと見ることができる。

【0082】要約すると、光学DUT30又は30'における偏光モード分散は図8に示すように判定することができる。いずれの場合も、行列M'が判定される。最

後に、ある種の測定上の形態学において、偏光モード分散を示す多くの装置及び(又は)回路網を連結して連鎖のを形成することができる。ここで本発明に従って上記の連鎖を達成する態様を説明する。

【0083】図10は3つの分散型光学装置又は回路網DUT A、DUT B及びDUTCの連鎖を示している。点線の矢印はDUT A、及びDUT Bを経て、指向性結合器100'へと向かうジョーンズ行列を示している。行列DはDUTA、及びDUT Bを経て、指向性結合器100'へと向かう偏光の変換を示している。行列EはDUT C(光学装置又は当該の回路網)を経て接続部2へと向かう偏光の変換を示している。行列FとGは接続部1と2に向かう偏光の変換をそれぞれ示している。

【0084】 DUT Cの偏光モード分散を判定するた めに、連鎖を経たジョーンズ行列は幾つかの信号挿入点 から、DUT Cの直前と直後の点までで判定されなけ ればならない。ジョーンズ行列は少なくとも2つの光波 長のそれぞれについて判定されなければならず、この例 では明瞭にするために正確に2つの周波数ω1及びω2 を考慮することにする。このシステムは最初に接続1が 行われるように構成され、次に行列積FDが2つの光波 長で定められる。次にシステムは接続2が行われるよう に構成され、次に行列積 G E D が同じ 2 つの波長にて定 められる。接続光ファイバと関連する(例えばF及びG における) 偏光モード分散はDUT Cにおける偏光モ ード分散と比較して無視できるものと想定される。この 仮定はほぼ $(\omega 1)$ = F $(\omega 2)$ であり、ほぼ G $(\omega 1)$ = G (ω2)であることを意味している。測定された行列の下 記の積とその逆の場合を考えてみる。

[0085]

【数25】

$$\tau_{PMO} = |\tau_{g,1} - \tau_{g,2}| = \frac{|Arg[c_1] - Arg[c_2]|}{\Delta\omega},$$
 (24)

【0086】単一ではない行列をRとすると、行列Q'= $R^{-1}QR$ はQと等しいということができる。同じ行列は同じ固有値を有することが判る。 $D(\omega 2)$ をRの代わりに置き換えると、方程式(25)からM' は $M'=E^{-1}(\omega 1)$ $E(\omega 2)$ J等しいことが判る。M' の固有値 C k を有する方程式(24) の $\Delta \omega = \omega 2 - \omega 1$ を用いて、 τ PMD が連鎖内の別の素子の分散作用とは関わりなく D UT C だけについて得られる。

【0087】連鎖内の一つの素子に於ける分散作用を遮 断するために、幾つかの信号挿入点から、当該の案子の 直前と直後の点までの2つの波長におけるジョーンズ行 列を測定するだけで充分である。2つの光周波数を1と 2を付して表記すると、偏光シンセサイザ50′から当 該の素子の直前の点までのジョーンズ行列をB1及びB 2 と呼ぶことができ、偏光シンセサイザから当該の素子 の直後の点までのジョーンズ行列をA1及びA2と呼ぶ ことができる。次に、遮断された当該の素子と関連する τ PMD の値が方程式 (24)から定めることができ、ここに $Ck L M'' = B2^{-1}BA1^{-1}A2$ の固有値である。要 約すると、偏光モード分散は図6に示すように検査中の 光学装置又は回路網を通る透過に基づいて判定すること ができる。更に、図9に示すように分析用の反射信号の 一部を分割するために光線分割器又は指向性結合器を使 用することによって光学装置又は回路網からの反射にお ける偏光モード拡散を測定することができる。これらの 偏光モード分散の判定は図2のマイクロプロセッサ27 によって行うことができる.

【0088】これまでの説明は主として例示する目的で出されたものである。検査中の光学装置における偏光モード分散を測定する方法と装置の種々の実施例を説明してきたが、下記の特許請求項の範囲と趣旨を逸脱することなく、多くのその他の偏光と修正が可能であることが専門家には明らかであろう。例えば、図7に示した集まる、現準及び集束レンズとを入れ換えることができる。偏光計の好ましい実施例を示したが、ジョーンズ行列を判定するためのストーク・パラメタを測定するために種々の偏光測定装置のいずれかを使用することができる。従い表明に従った偏光モード分散を判定するために不発明に従った偏光モード分散を判定するためにでは、本発明に従った偏光モード分散を判定するものでは、本発明に従った偏光モード分散を判定されるものでは、本発明に記載した特定の測定装置に限定されるものではない。更に、反射特性の測定は図9及び図10にそれぞれ示した指向性光学結合器100又は100'の代わ

りに光線分割器を用いても行うことができる。従って、 本発明の範囲は添付の特許請求項によってのみ限定され るものである。

[0089]

【発明の効果】以上の如く本発明によれば、光学装置における偏光モード分散を判定できるように、光線の異なる偏光状態を生成し、且つ検査中の光学装置による光線への作用によって生ずる偏光状態を測定することができる。さらに、本発明は波長の大部分の範囲に亘ってこのような偏光モードを判定でき、また測定システムにおける不都合な分散的な要素の作用の校正が簡便におこなえる。

【図面の簡単な説明】

【図1】従来の偏光モード分散測定装置の一例を示す図 である。

【図2】従来の偏光モード分散測定装置の一例を示す図 20 である。

【図3】従来の偏光モード分散測定装置の一例を示す図 である。

【図4】従来の偏光モード分散測定装置の一例を示す図 である。

【図5】 従来の偏光モード分散測定装置の一例を示す図 である

【図6】本発明の一実施例を示す図である。

【図7】図6における偏光計の一例を示す斜視図である。

30 【図8】本発明における偏光モード分散を決定する方法を示すフローチャートである。

【図9】本発明の他の実施例を示す図である。

【図10】本発明の更に他の実施例を示す図である。 【符号の説明】

9:光源

10: 偏光計

11:光ファイバー

12:集束凹面鏡

18~21:光検出機構

40 27:マイクロプロセッサ

30: DUT

40:光源

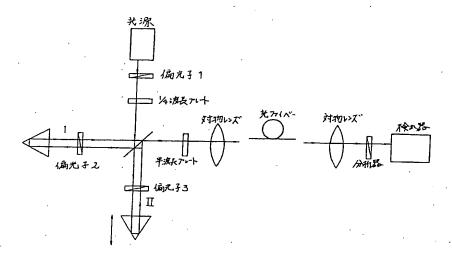
50: 偏光シンセサイザー

50a、50b、50c: 偏光子

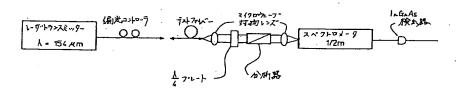
【数26】

 $[FD(\omega_2)]^{-1}[FD(\omega_1)][GE(\omega_1)D(\omega_1)]^{-1}[GE(\omega_2)D(\omega_2)] = D^{-1}(\omega_2)E^{-1}(\omega_1)E(\omega_2)D(\omega_2) = M''.$ (25)

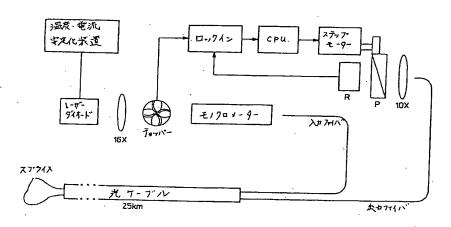
【図1】



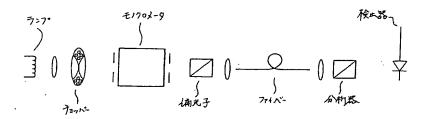
【図2】



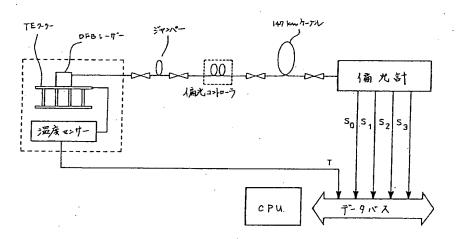
[図3]



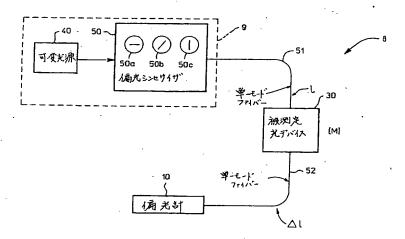
[24]



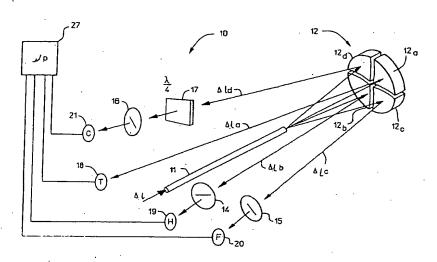
[図5]



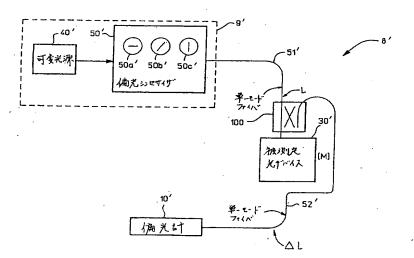
√【図6】



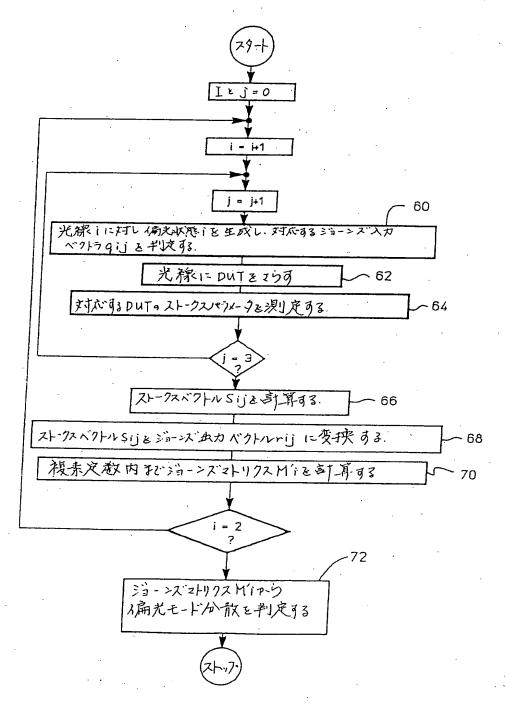
[図7]



【図9】



[図8]



[図10]

